

## 走査型電子顕微鏡 (FE-SEM/EDX)

前処理重要



## 【サンプルについて】

1. 真空中でガスや液体を放出しないもの
2. 設置上限サイズφ200mm×高さ80mm  
(観察可能領域 中央部φ71mm)

## 【主な仕様】

- ・分解能: 二次電子像1.2nm(30kV,WD5mm)
- ・電子銃: ZrO/Wショットキー
- ・加速電圧 0.5~30kV  
(リターディング使用時0.1kV可能)
- ・検出器: 二次電子検出器(高真空Lower, Top/低真空), 反射電子検出器
- ・分析元素: Be~Am(分解能128eV)

## 【データ出力】

記録メディア

USB, CDR, DVDR

保存形式

Jpeg, Excel, Word等

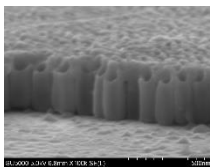
## 機種名

日立ハイテクノロジーズ SU5000  
+EDAX Pegasus EDS/EBSP  
2016年度購入

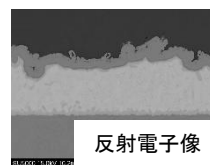
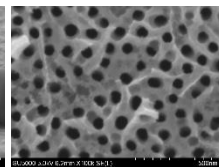
## 特徴

- 高真空/低真空モード切替可能
- 大口径70mm<sup>2</sup>シリコンナイトライドSDD検出器
- 元素分析, 線分析, 元素マッピングが可能
- EBSPによる結晶方位解析が可能
- 分析アプリケーションソフトウェア
  - ・TEAMソフトウェア
  - ・OIM Data Collection (EBSPデータ収集)
  - ・OIM Analysis (EBSPデータ処理)

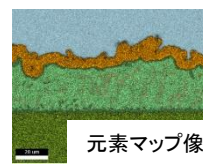
## 【観察例】



酸化チタンナノチューブの二次電子像

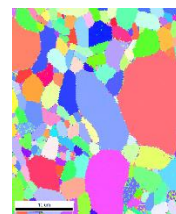


反射電子像



元素マップ像

異種金属接合部の断面



アルミナ焼結体の結晶方位解析

## 料金等

- 機器使用: 4,500円/時  
 操作法説明: 7,800円(2時間)  
 表面観察: 7,300円/件(5万倍以下)  
           8,500円/件(5万倍超過)  
 定性分析: 8,500円/測定

※詳細についてはお問い合わせ下さい。

## 研究員による支援

3,900円 / 時

## 解析の支援

光軸, 非点補正補正, 撮影など

## 試料の前処理指導

切断, 研磨(450円/件),  
埋込(750円/件)

ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。